

Sif Doula B. - Né en 1975
95110 Sannois
2 ans d'expérience
Réf : 709210942

Ingenieur generaliste

Ma recherche

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Bâtiment.

Formations

1999 : diplôme d'études supérieures en physique, option rayonnement + 2004 : master 2 professionnel (bac + 5)
spécialité : technologies et applications des plasmas

Expériences professionnelles

2005/2007 Agent de Sécurité pour Uniprotect Sécurité (gestion des alarmes, accueil du public, télésurveillance), Ile de France.

2004 Ingénieur Process et Mise au point (stage/6mois) chez Alliance Concept (Cran-Gevrier74) : SARL spécialisée dans la fabrication d'équipements et de machines industrielles pour les applications plasma (dépôts de couches minces par CVD, PVD, évaporation et gravure sèche), techniques du vide et de contrôle d'étanchéité (Personnel : 50 ; CA : 6 millions d'Euros). Intitulé du rapport : Dépôts par pulvérisation magnétron et par évaporation sous vide. (Câblage, montage et optimisation des procédés : prototype EVA300) Caractérisation sur le site www.alliance-concept.com Essais expérimentaux : ØDépôts de chrome et d'aluminium sur des substrats en verre ØOptimisation d'uniformité d'épaisseur et amélioration de la vitesse du dépôt ØCaractérisation plasma et différents paramètres du système ØAmélioration de mouillabilité pour le collage d'échantillons en Hypalon et Néoprène ØApplication du Lift Off pour dépôt d'Al silicium (Epaisseur 0.3µm pour une résine de 2.5µm) ØGravure sèche sur substrats en silicium

2001/2003 Gérant à WEB GATE : Service de traitement de données et navigation Internet, Batna, Algérie.

Langues

- Français bilingue, Anglais (cours intensifs). parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences

- Elaboration, gestion de projet, coordination et management
- Procédés plasmas : nettoyage des surfaces, dépôt (Al, SiO₂ par PVD et CVD), gravure (SF₆), implantation ionique par immersion plasma
- Optimisation d'un procédé IPVD pour le dépôt de couches minces
- Traitements de surface: Polymères (amélioration de mouillabilité).Lithographie
- Diagnostics plasmas :
 - Øélectrique (sonde de Langmuir, polarisation RF d'un substrat)
 - Øoptique (actinométrie)
- Tests de fuite à l'hélium et amélioration des systèmes de pompage
- Techniques expérimentales : Dosimètres et Détecteurs à Gaz
- Informatique : calcul scientifique (Matlab), Fortran, Pascal, Script UNIX
- Traitement du signal et acquisition de données/Propriété Industrielle (Expert)

Permis

B

Centres d'intérêts

- VTT, natation